# PREPARATION OF ALUMINA WITH LOW CONTENT OF RADIOACTIVE ELEMENT

Patent number:

JP56164013

**Publication date:** 

1981-12-16

Inventor:

SHIODA SHIGEAKI; MATSUKI TSUTOMU; KAZAMA

SOUICHI; SAKAMOTO AKIRA; HIRAYANAGI

KOUTAROU

Applicant:

SHOWA KEIKINZOKU KK

Classification:

- international:

C01F7/02

- european:

Application number: JP19800067910 19800523 Priority number(s): JP19800067910 19800523

Report a data error here

## Abstract of JP56164013

PURPOSE:To obtain alumina suitable for using in a semiconductor memory apparatus, by pulverizing a calcined alumina consisting of substantially an alpha-crystal, and washing the pulverized crystal with a dilute mineral acid solution. CONSTITUTION:Calcined alpha-alumina must be finely pulverized in order to elute uranium and thorium in a solution of a mineral acid, e.g. nitric acid, by the treatment with the mineral acid solution. After the treatment, the alumina is separated from the mineral acid solution by the solid-liquid separation. The nitric acid is most effective as the mineral acid, and followed by sulfuric acid. Hydrochloric acid has a little effect. The concentration of the mineral acid is preferably about 0.5-0.1N. The resultant separated alumina is then washed fully with water and dried.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報(A)

昭56-164013

⑤Int. Cl.³C 01 F 7/02

識別記号

庁内整理番号 7106-4G **3公開 昭和56年(1981)12月16日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

20特

顧 昭55-67910

22出

願 昭55(1980)5月23日

仰発 明 者 塩田重昭

横須賀市二葉2丁目34の14

仰発 明 者 松木勤

横浜市金沢区釜利谷町2186の15

3

仰発 明 者 風間聰一

綾瀬市深谷115の14

⑫発 明 者 坂本明

東京都大田区東矢口1丁目4番

6の402号

⑫発 明 者 平柳幸太郎

横浜市瀬谷区瀬谷町3870の4

⑪出 願 人 昭和軽金属株式会社

東京都港区芝公園一丁目7番13

号

⑩代 理 人 弁理士 青木朗 外3名

明 細 署

1. 発明の名称

放射性元素含有掛の少ないアルミナの製造 方法

#### 2. 特許請求の範囲

1. 実質的にアルファ晶よりなる焼成アルミナを粉砕し、希薄な鉱酸液中で洗浄することを特徴とする放射性元素含有量の少ないアルミナの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は放射性元素の含有情が極めて低いてルミナの製造方法に関するものであり、さらに詳しく述べるならば半導体メモリ装置のパッケーツ等に用いるのに適したアルミナの製造方法に関するものである。

半導体メモリ装置では、MOSトランシスタ及びキャパンタを用いて電荷をメモリセル中に注入、 貯蔵し且つメモリセルから取出して、電荷の有無 により0又は1の情報を検知するMOSBAM タイ プの装置が現在主に用いられている。この

MOSRAM では数ミリ角のシリコン基板の上に16 Kビットのメモリセルが構成されており、今後64 Kピット又は256Kピットと高集積化されて行 くことが予測される。これに伴なつて1個のメモ リセルが増々小型化されるが、との事はメモリセ ルが偶発的に放射線粒子の衝突を受けると1個の アルフェ線粒子によりメモリセル中の電荷量と同 程度の電荷を生じ、情報のエラー(ソフトエラー) を生じる危険があることを意味している。そこで かかるソフトエラーを防止するための種々の対策 が半導体装置製造の分野で知られている。すなわ ち、メモリセル・パッケージ材にアルファ観遮蔽 コーティングを施すとか、あるいは半導体メモリ 装儠に エラー訂正回路を組み込むなどがそれ であ るが、これらはいずれもメモリ装置の製造コスト を増大するのみでなく、高集積化に障害をもたら す。従つてメモリセルパッケージ材中のアルファ 線放射線元衆をソフトエラーを生じない水準に被 少させることが望ましい対策である。だが、パッ ケージの材質中の放射線元素の含有量を望ましい

水準に低下させる技術は現在のところ知られていない。本発明者はパッケージの主成分であるアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量をアルミナ製造の過程でその原料中の含有骨よりも格に適したアルミナを製造することを目的として研究を行なつた。ところで、アルファ線の測定は放射線束が少ない場合、これを正確に行なりことはなかなか困難で特に0.1 カウント/hr・al 以下の低領域になると非常に困難であり、信頼できる測定装置は未だ開発されていない。

したがつて、半導体メモリ装置のパッケージ用 アルミナの製法を開発するに当つて、先ずアルフ ァ線を定程的に把握する方法を定める必要があつ た。この点に関し、アルミナ中に含まれる放射性 元素はウラン(U)及びトリウム(Th)である。ウ ラン(U)はウラン又はアクチニウム崩壊系列に従 つて、またトリウム(Th)はトリウム崩壊系列に 従つて崩壊し、最終的には安定な鉛になる。その 崩壊過程において、1原子のU<sup>238</sup>は8個のアルフ

(3)

ppm以下好ましくは約0.1 ppm以下まで低下させるとソフトエラーを防止できるとの発想のもとに極低ウラン・トリウム含有アルミナ製法の研究を行なつたものである。

本発明の目的は半導体メモリ装置内で用いるの に適した、極低放射性元素含有量のアルミナを製 造する方法を提供することにある。

本発明に係る方法は、実質的にアルファ晶より なる焼成アルミナを粉砕し、希神な鉱酸液中で洗 浄することを特徴とする。

以下、本発明を工程順に説明する。

工業的にアルミナを製造するにはポーキサイトを原料としてパイヤー法により後述する処理を施している。パイヤー法の原料のポーキサイトは産地、鉱区によつて多少異なるが、わが国で用いられているものは3ないし5 ppmのウラン及び5~10 ppmのトリウムを含有している。このようなポーキサイトを苛性ソーダ液に溶解し、不溶解分(赤泥)を沈殿させた時大半のウラン及びトリウムは不溶性赤泥とともに沈殿するが、一部はアル

ァ線粒子を、また1原子のU<sup>236</sup>は7個のアルファ 線粒子を、トリウム(Th<sup>232</sup>)は6個のアルファ線 粒子を放射することは、それぞれの崩壊系列によ り定まつている。この他、ウラン、トリウムの核 分裂から生ずる放射性 元素のラジウム (Ra) 、プ ロトアクチニウム(Pa)、アクチニウム(Ac)等 があるが、これらはその成因からみて本発明によ る含有低低減の対象外である。従つて、アルミナ のアルファ線を測定しなくとも、ウラン又はトリ ウムを化学的に分析すれば、ウラン又はトリウム のアルミナ中の含有原子数 からアルファ 線粒子の 放射個数を計算することができる。なお、ウラン 又はトリウムの化学的分析精度は、中性子放射化 分析によると、10<sup>-8</sup>~10<sup>-10</sup>grまで、またウラ ンは螢光分光分析によると10<sup>-10</sup>~10<sup>-10</sup>%r程度 までの十分に高い精度を有するものである。以上 のような分析事情に基づいて、本発明者は現状の アルミナ中の 0.5 ~ 1.0 ppm 程度のウラン及び 0.0 2 5 ~ 0.0 5 ppm程度のトリウム含有散に対 し、ウランおよびトリウムの合計含有量で約0.2

(4

ミン酸ソーダ溶液中に移行する。このようなアルミン酸ソーダ溶液から加水分解により析出させた水酸化アルミニウムは約0.4 ppmのウラン及び約0.0 2 ppmのトリウムを含有している。かかる水酸化アルミニウムを1200℃以上、好ましくは1250~1500℃に挑成するとアルファ(a)晶の割合が99 が以上の実質的にアルファ晶からなる焼成アルミナが得られる。このアルミナ中にはウラン約0.6 ppm、トリウム約0.0 3 ppmが含有されている。

本発明によると上記実質的にアルファ晶からなる焼成アルミナ(以下 これをα焼成アルミナと称する)に粉砕及び鉱酸洗浄の処理を施すが、先ず粉砕の意義及び方法について説明する。

α焼成アルミナは1200℃以上、好ましくは
1250~1500℃の高温で焼成されているために、アルミナ単結晶粒子が凝集しており、約30~80ミクロンの寸法の塊状になつている。この
状態で鉱酸洗浄処理を行なつてもウラン等の放射
性元素は鉱酸液中に十分に溶出しない。そこで粉

<del>--70--</del>

次に、軟酸洗浄処理の意義及び方法について説明する。

本発明の方法によると、α焼成アルミナは散制 に粉砕されるため極めて多くの粉砕面が露出して いるがかかる状態が鉱酸洗浄によりウラン等を溶

(7)

かと同時に洗剤するものでもよく、後者の場合は 通常湿式粉砕と称されている粉砕法となる、この 場合は、鉱酸液中で粉砕され、粉砕されたα焼成ア ルミナが直ちに鉱酸により洗浄される。詳しくは、 鉱酸による洗剤の溶出作用はα焼成アルミナがあ る程度の粒度まで細分された時点で活発化すると 考えられる。

続いて、飲酸洗浄処理後の工程について説明する。 飲酸洗浄処理によりウラン等を溶解した液はデカンテーションあるいはろ過法等により固液分離し、残消であるα焼成アルミナ粒子を水で十分に洗浄した後乾燥する。 かくして得られたαアルミナ中のウラン等の放射性元素の含有量は処理前の原粒アルミナ(α焼成アルミナ)に比較して20~5 まに低下している。

本発明の対象となるアルミナは、アルファ晶よりなる焼成アルミナであればよく、パイヤー法水酸化アルミニウムの焼成によつて製造されるアルミナに限定されず、焼結饵子材料用低ソーダアルミナのごときアルファアルミナ等を包含するもの

出させるための必要条件である。そして、鉱酸処 理によりウラン及びトリウムが鉱酸液中に溶出さ れ、しかる後適当な固液分離手段によりα焼成ア ルミナが残渣として鉱酸液から分離される。この ようなウラン等の除去効果に関しては、硝酸が最 も効果が大きく、原料アルミナ(α焼成アルミナ) 中のウラン含有份 0.3 ~ 0.7 ppm を 0.1 ~ 0.0 3 ppmに低下させることができる。硝酸に次ぐ除去 効果を有するものは硫酸である。これらの酸に比 ぺて塩酸はやや効果が低い。これらの鉱酸の濃度 は低濃度の方が高温度より好ましく、例えば 0.5 ~0.1 N の希酸溶液をα焼成アルミナ粉砕粒子の 洗浄処理に使用する。次に、鉱酸液の温度は特に 制限がなく常温でもよく又は若干加温してもよい。 さらに、α焼成アルミナ粉砕粒子の洗浄処理条件 は、洗浄貴及び時間を考慮して適宜定めればよい が、一例を挙げると鉱酸液1 んにつき 0.8 ~ 1.2 Wのα焼成アルミナ粉砕粒子を撹拌しながら30 分~1時間鉱酸処理するものであつてもよい。を お、洗浄処理の時期は、粉砕後でもよく、また粉

(8)

である。

以下、寒施例により本発明をさらに詳しく説明する。

#### 実施例1

#### 與施例2

0.5 N 硝酸に代えて 0.5 N の硫酸を使用した他

は実施例1 と同じ条件でα 競成アルミナを処理したところ得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びトリウムの含有層はそれぞれ0.0 4 及び0.0 1 9 ppm であつた。

#### 实施例3

0.5 N 硝酸に代えて 0.5 N の塩酸を使用した他は実施例1 と同じ条件でα 焼成アルミナを処理したところ、得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ 0.0 5 及び 0.0 2 1 ppm であつた。

#### 実施例4

0.5 N 硝酸と 0.5 N 硫酸の等量混酸液を使用した他は実施例1 と同じ条件でα焼成アルミナを処理したところ、 得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びトリウムの含有質はそれぞれ 0.0 3 ppm 及び 0.0 1 8 ppm であつた。

#### 奥施例5

硝酸の濃度を0.5 Nから2Nに変えた他は実施例1と同じ条件でα焼成アルミナを処理したところ、得られた鉱酸洗浄アルミナ中のウラン及びト

(11)

酸液中における湿式粉砕である。 得られた鉱酸洗 浄アルミナ粒子は平均粒子径1.4 μでウラン及び トリウムの含有量はそれぞれ0.0 4 ppm 及び0.0 2 ppm であつた。

#### 比較例1

実施例1の方法で得られたα 焼成アルミナ200 grを粉砕せずに、0.5 N 硝酸液 200 mlに1時間 受せき後ろ過洗浄乾燥したところ、得られたアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ 0.3 9 及び 0.0 3 0 ppm であつた。

## 比較例2

実施例7の原料アルミナを実施例6と同一の条件で粉砕せずに鉱酸洗浄処理したところ得られたアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ0.35 ppm 及び0.020 ppm であつた。

## 特許出願人

昭 和 軽 金 寫 株 式 会 社 特許出顧代理人

弁理士 實 木 鈅 弁理士 饀 和 之 西 弁理士 村 # 虚 1# 弁理士 Ш 之 リウムの含有量はそれぞれ 0.1 3 及び 0.0 2 5 ppm であつた。

#### 実施例6

実施例1の場合と間様に電気炉で焼成して得たα焼成アルミナ200grを、2んのアルミナポットに直径20mmのアルミナポール1.6 Wと共に入れ、90rpmの回転数でアルミナポットを回転しながら8時間乾式粉砕した。

得られた粉砕アルミナ粒子 5 0 9r を実施例 1 と同じ硝酸液 5 0 ml に 1 時間浸せき後ろ過し、さらに 2 0 0 ml の水で水洗・乾燥したところ、得られたアルミナ中のウラン及びトリウムの含有量はそれぞれ 0.0 5 及び 0.0 2 4 ppm であつた

#### 実施例 7

市販の焼結電子材料用低ソーダアルミナ (Na<sub>2</sub>O 0.0 6 重量を )を原料として、鉱酸洗浄処理を行つた。原料アルミナは平均粒子径 2.2 μの事実上αアルミナであり、ウラン含有量 0.4 0 ppm、トリウム含有量 0.0 2 4 ppm である。

鉱酸洗浄処理条件は実施例1と同様の0.5 N 硝

02

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.